

აბრეშუმის პაცის სისტის კონტროლი ტენცოგარდამქველის გამოყენებით

ზურაბ ჯოხარიძე, ვლადიმერ ფადიურაშვილი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

რეზიუმე

განხილულია აბრეშუმის პარკებიდან შვიდწევრა კომპლექსური ძაფის ამორლვევისას ძაფის სისქის კონტროლი, რომელიც უნდა იყოს 90–105 მ–ის ფარგლებში. 7 პარკიდან კომპლექსური ძაფის ამორლვევისას ხდება ძაფის ჩაწყვეტა, ანდა პარკიდან სრული ამორლვევა, რაც იწვევს კომპლექსური ძაფის გაწვრილებას. ეს არის ძირითადი მიზეზი ქსოვისას ე.წ. „წყვეტიანობის“ ზრდისა და წუნდებული ქსოვილის მიღებისასტატიაში შემოთავაზებულია არსებული პრობლემის გადაწყვეტის თანამედროვე მეთოდი ტენცოგარდამქნელისა და მიკროპროცესორის გამოყენებით.

საკვანძო სიტყვები: ტენცორეზისტორი. იკროპროცესორი. წირითი გაფართოება.

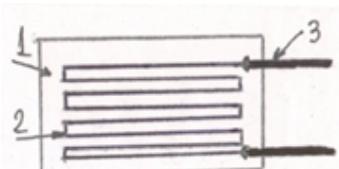
1. შესავალი

დღეს არსებულ აბრეშუმის ძაფსარღვევ დანადგარზე კომპლექსური 7-წევრა ძაფის სისქის კონტროლი ხორციელდება ელექტრო-მექანიკური კონტაქტური მოწყობილობით. აღნიშნული კონტაქტორი და აღმსრულებელი მოწყობილობა გამოირჩევა ინერტულობითა და მცირე სიზუსტით. თუ გავითვალისწინებთ, რომ აბრეშუმის კომპლექსური ძაფი „გარბის“ 100 მ/წთ სიჩქარით, უთანაბრო ძაფი დოლზე აიხვევა min- 100 მეტრი, რაც ქსოვის დროს საგრძნობლად იჩენს თავს.

ჩვენს მიერ ელექტრომექანიკური კონტაქტორის მაგივრად შემოთავაზებულია ტენცოგარდამქნელით აბრეშუმის კომპლექსური ძაფის სისქის კონტროლს. გამზომი ბოგირიდან, რომლის ერთ-ერთ მხარში ჩართული იქნება ტენცომგრძნობიარე ელემენტი, ცვალებადი სიგნალი მიეწოდება მიკროპროცესორს, რომელიც თავის მხრივ, ჩართავს პარკის მიწოდების სისტემას. ეს ოპერაცია შესრულდება ელექტრონის მოძრაობის სიჩქარით.

2. ტენცორეზისტიული პირველადი გარდამქნელი

ტენცორეზისტიული პირველადი გარდამქნელის მუშაობის პრინციპი დაუუმჯებულია ე.წ. ტენცოეფექტზე, რაც გარკვეული მასალის გამტარზე მექანიკური ზემოქმედებისას მისი აქტიური წინაღობის ცვლილებაში გამოიხატება. გარდამქნელის დასამზადებლად ძირითადად იყენებენ კონსტანტანის მავთულს $0,02 - 0,05$ მმ დიამეტრის, რომლის ტენცომგრძნობიარობის კოეფიციენტი $S = 1,9 - 2,1$. ასეთი მავრთულის ხვიები მოთავსებულია გალაქულ ქაღალდის ფირფიტებს შორის (ნახ.1).



ნახ. 1. ქაღალდის ფირფიტა (1), კონსტანტანის სადენი (2),
საკონტაქტო გამომყვანები (3)

გარდამქმნელი წებდება მექანიკური ზემოქმედების ობიექტზე. ობიექტის დრეკადობისას ტენზორეზისტორის შიგა წინაღობის ფარდობითი ცდომილება არის:

$$\frac{\Delta R}{R} = S \frac{\Delta l}{l},$$

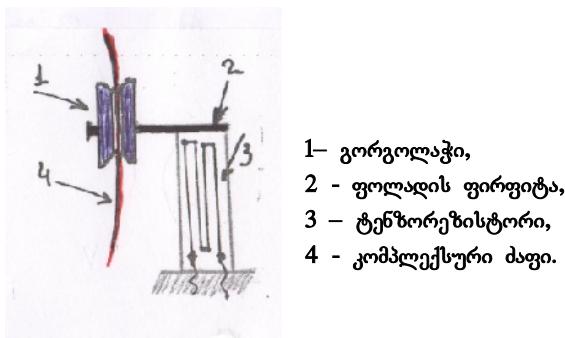
სადაც S ტენზომეტრის კოეფიციენტია,

$\frac{\Delta R}{R}$ -ფარდობითი წინაღობა,

$\frac{\Delta l}{l}$ -სადენის ფარდობითი დეფორმაციაა.

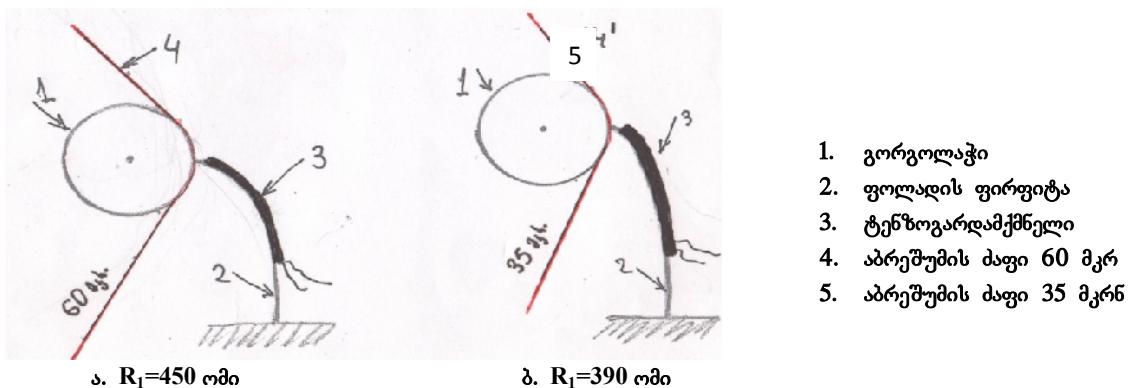
გარდამქმნელი კეთდება სხვადასხვა ზომისა და მგრძნობიარობის. ჩვენ შემთხვევაში მოსახერხებელია ტენზორეზისტორი TnzS - 0.351, რომლის სადენის სიგრძე 50 მმ-ია, ხოლო შიგა წინაღობა „სიმშვიდის“ მდგომარეობაში 300 ომის ტოლია.

გარდამქმნელი წებდება ცალმხრივდაფიქსირებულ ფოლადის თხელ, დრეკად ფირფიტაზე, რომლის მეორე, თავისუფალ ბოლოზე მიმაგრებულია გორგოლაჭი (ნახ.2).



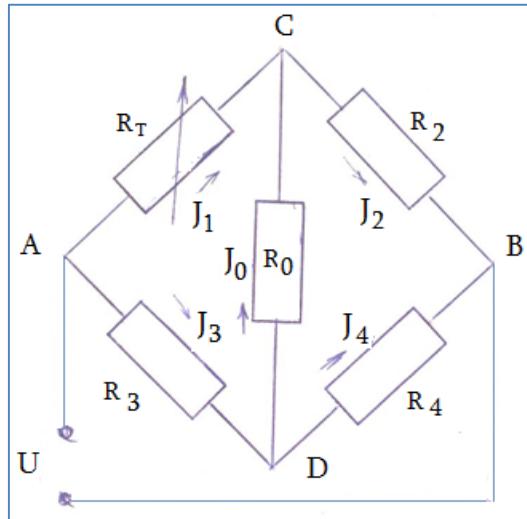
ნახ.2

4 კომპლექსური ძაფი 1 გორგოლაჭიზე გარკვეული მოჭიმულობით ხრის 2 ფირფიტას. ცდით დადგნდა, რომ 60 მკრ. სისქის ძაფი ანიჭებს 2 ფირფიტას ისეთ დეფორმაციას (ნახ.3.ა), რომ 3 ტენზორეზისტორის შიგა წინაღობა იზრდება 450 ომამდე.



ნახ. 3

ვთქვათ, რაღაცა მიზეზით შვიდწერა ძაფს მოაკლდა სამი წვერი. ე.ი. ძაფი 60 მკრ-ის ნაცვლად გახდა 35 მკრ. 1 გორგოლაჭზე მოიკლებს ძალა და გარდამქმნელი დაიკავებს „ბ“ მდგომარეობას. შესაბამისად, შემცირდება გარდამქმნელის შიდა წინაღობა $R = 390$ ომი.



ნახ.4

კირხოფის პირველი კანონის თანახმად:

$$I_0 = U / (R_T R_4 - R_2 R_3) / R_0 (R_T + R_2)(R_3 + R_4) + R_T R_2(R_3 + R_4) + R_3 R_4(R_T + R_2) \quad (1)$$

ბოგირი წონასწორობაშია მაშინ, როცა $I_0 = 0$ ანუ როცა $R_T R_4 = R_2 R_3$.

ვთქვათ, შეიცვალა R_T წინაღობის მნიშვნელობა ΔR -ით. მაშინ (1) განტოლება მიიღებს სახეს

$$\Delta I = U \Delta R_T R_4 / R_0 (R_T + R_2)(R_3 + R_4) + R_T R_2(R_3 + R_4) + R_3 R_4(R_T + R_2). \quad (2)$$

ჩვენ შემთხვევაში ბოგირი წონასწორობაში იქნება, თუ $R_T = 450$ ომი, $R_2 = R_3 = 150$ ომი, ხოლო $V = 30$ ვოლტია.

როდესაც კომპლექსური ძაფი 60 მკრ-ია, $R_T = 450$ ომს და ბოგირი წონასწორობაშია. ე.ი. C და D წერტილებს შორის პოტენციალთა სხვაობა 0-ის ტოლი იქნება და ოპერაციული გამაძლიერებლის „+“ და „-“ შესასვლელებს ტოლი სიგნალი მიეწოდებათ. ეს განაპირობებს ოპერაციული გამაძლიერებლის გამოსასვლელზე 0-ის ტოლ სიგნალს.

როგორც კი ძაფის გაწვრილების გამო შეიცვლება R_T მნიშვნელობა, $R_T = 390$ ომი, C და D წერტილს შორის გაჩნდება პოტენციალთა სხვაობა. ოპერაციული გამაძლიერებლის გამოსასვლელზე გვექნება სიგნალი, რომელიც მიეროპროცესორის ერთ-ერთ შესასვლელს მიეწოდება. მიეროპროცესორის შესაბამის გამოსასვლელზე გაჩნილი სიგნალი გახსნის ტრანზისტორს, რომელიც, თავის მხრივ კვებას მიაწვდის პარკის ავტომატურ მიმწოდებელს. პარკის მიმწოდებელი თვითწამლებისკენ გადაისვრის თავმოძებნილ პარტს და ეს გაგრძელდება მანამდე, ვიღრე ძაფი არ გახდება 60 მკრ. ანუ, ვიღრე მიეროპროცესორის 4 შესასვლელზე სიგნალი 0-ის ტოლი არ გახდება.

3. ტენირებისტორის მეტროლოგური მახასიათებლები საზომ წრედებში

ტენირებისტორის ცდომილების წყაროებია: ცოცვადობა, მექანიკური პისტერებისი, წირითი გაფართოების კოეფიციენტის სხვადასხვაობა (გარდამქმნელსა და გასაზომ ზედაპირს შორის), წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტი.

$$\text{ცოცვადობის გავლენა } \frac{\Delta l_\beta}{l} = \frac{\Delta l_\varphi}{l},$$

სადაც Δl_β ცოცვადობის შეიძლება შევაფასოთ სიღილით : $\Delta l_\beta = \frac{\Delta l_\varphi}{l}$

თანამედროვე ტენირებისტორებში მასალებისა და ტექნოლოგიების შერჩევით, ეს ცდომილება დაიყვანება $0,1 - 0,2\%$ -მდე.

ისევე როგორც ცოცვადობა, მექანიკური პისტერებისიც განპირობებულია ტენირებისტორის მასალის დრეკადი თვესებების არასრულფასოვნებით. მექანიკური პისტერებისი გამოვლინდება შემდეგნაირად: თუ, ტენირებისტორზე ერთ შემთხვევაში თანდათან გაუზრდით დეფორმაციის ძალას, მეორე შემთხვევაში თანდათან შევამცირებთ. გამოსასვლელი წინაღობის მნიშვნელობები ამ ორ შემთხვევაში განსხვავებული იქნება. ეს განსხვავება, ანუ პისტერებისი დამიკიდებულია ტენირებისტორის დამზადების ტექნოლოგიაზე. სრულყოფილი ტექნოლოგიის პირობებში ცოცვადობითა და პისტერებისით გამოწვეული ცდომილება შეიძლება 1% -მდე იქნას დაყვანილი.

აგრეთვე, ტენირებისტორის ცდომილების ერთ-ერთი წყაროა ტემპერატურული არასტაბილურობა. ტემპერატურული ცდომილების შეცირება შესაძლებელია საზომ წრედებში კომპენსაციური წინაღობის ჩართვით (ჩვენ შემთხვევაში R_3 წინაღობის შერჩევა).

დაუუშვათ, რომ დეტალისა და მასზე დაწებებული ტენირებისტორის წირითი გაფართოების კოეფიციენტებია β_φ – დეტალისა და β_β – გარდამქმნელისა. ვთქვათ, ტემპერატურამ მოიმატა 10 -ით. ამის შედეგად გარდამქმნელი მიიღებს დეფორმაციას:

$$\frac{\Delta l}{l} = \beta_\varphi - \beta_\beta.$$

შედეგად, ტენირებისტორის ფარდობითი ცდომილება იქნება:

$$\frac{R}{R_0} = K(\beta_\varphi - \beta_\beta).$$

ვითვალისწინებთ, რომ $K = \frac{\Delta R/R}{\Delta l/l}$, წინაღობის აბსოლიტური ნაზრდი იქნება:

$$(R)_1 = R K (\beta_\varphi - \beta_\beta).$$

ტენირებისტორის წინაღობის შეცვლა შესაძლებელია აგრეთვე მისი მასალის შიგა წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტის ცვლილებით. 10 ცვლილებისას, გაფართოების პირობებში, წინაღობის ნაზრდი იქნება:

$$(R)_2 = R \alpha$$

რადგან $\frac{R-R_0}{R_0} = \alpha t$, ორივე მიზეზით ტენიორეზისტორის წინაღობის ჯამური ნაზრდი იქნება:

$$R = (R)_1 + (R)_2 = R(\alpha + K(\beta_{\varphi} - \beta_{\beta})).$$

საშიშროება მდგომარეობს იმაში, რომ წინაღობის ΔR ნაზრდი შეიძლება აღქმულ იქნას, როგორც საზომი ინფორმაციის სიგნალი. ეს რომ ავიცილოთ თავიდან, ტენიორეზისტორის მეზობელ მხარში უნდა ჩაერთოთ ისეთი წინაღობა, რომელიც ტემპერატურის ზემოქმედებისას ისევე იცვლება, როგორც ტენიორეზისტორი.

აღნიშნოთ საკომპენსაციო წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტი α_k , მაშინ

$$\Delta R_k = R_k \alpha_k.$$

აქედან გამომდინარე:

$$R_k = \frac{R_k}{\alpha_k} = \frac{R}{\alpha_k} = \frac{R(\alpha + K(\beta_{\varphi} - \beta_{\beta}))}{\alpha_k}.$$

ტენიორეზისტორების საზომ წრედებად გამოიყენება ოთხმხრიანი უწონასწორო ბოგირები, სადაც ტენიორარდამქმნელი ირთვება 1, 2 ან ოთხივე მხარში. ერთ მხარში ჩართული გარდამქმნელი აუცილებლად ითხოვს, მეზობელ მხარში საკომპენსაციო წინაღობის R_k -ს ჩართვას, რომელიც იანგარიშება ზემოთმოყვანილი ფორმულით.

ორ მხარში ჩართული ტენიორარდამქმნელები აკომპენსირებს ცოცვად, პისტერეზისულ და ტემპერატურულ ცდომილებებს და ორმაგებს საზომ სიღიდეს.

ოთხივე მხარში ჩართული ტენიორეზისტორების მგრძნობიარობის კოეფიციენტი ძალიან მაღალია. მაგრამ, საკმაო სირთულეს წარმოადგენს ერთნაირი პარამეტრების მქონე 4 გარდამქმნელის შერჩევა. მათ შორის პარამეტრების სხვაობა საზომ წრედებში აღითქმება როგორც საზომი სიღიდის ცვლილება. რაც საგრძნობ შეუსაბამობას ქმნის.

4. დასკვნა

ამრიგად, ტენიორეზისტორის გამოყენება საგრძნობლად აუმჯობესებს სწრაფქმედებას და საიმედოობას, მაგრამ ცდომილებების ასაცილებლად, გამოთვლებიდან გამომდინარე, საჭიროა მეზობელ მხრებში ჩართული ტენიორარდამქმნელების ჩაყენება. რაც, ჩვენ შემთხვევაში, განხორციელდება მე-3 ნახაზზე, შიგა მხრიდან მეორე მე-2 ფოლადის ფირფიტაზე ტენიორარდამქმნელის დაწებებით, ანუ მე-4 ნახაზზე R_3 რეზისტორის ნაცვლად სქემაში ჩადგება R_T ტენიორეზისტორის ანალოგური ტენიორეზისტორი.

ლიტერატურა:

1. ზედვინიძე ი. კალიჩევი რ. (1998). პოტენციომეტრული გაზომვების მეთოდიკა.სტუ, თბილისი
2. უვანია რ. (1998).გამოყენებითი მეტროლოგია. სტუ, თბილისი
3. ღოლიძე ვ., ალხაზიშვილი ტ. (1988.). ტექნიკური ტერმინოლოგის სარჩევი თონომეტრიაში. „მეცნიერება”. თბილისი
4. უვანია რ. (1985). პირველადი საზომი გარდამქმნელები. სპი. თბილისი
5. გიორგობანი ნ., გლოველი შ. (1990). გაზომვათა ერთიანობის საფუძვლები„განათლება”. თბილისი.

**CONTROL OF THE THICKNESS OF SILK THREAD USING
TENZOSENSORS**

Jokharidze Zurab, Phadiurashvili Vladimir

Georgian Technical University

Summary

This paper focuses on controlling the thickness of the silk thread with voltage. At the request of the silk thread should life smooth, continuous in length and uniform in thickness, by adding together the number of control silk thread pattern during its production is to obtain information accurately reflects the value of the thickness of the thread. For the Control process we use tensosensors and microprocessors.

**УПРАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНОЙ ШЕЛКОВОЙ НИТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ**

Джохаридзе З., Фадиурашвили В.
Грузинский Технический Университет

Резюме

Рассматриваются вопросы контроля толщины шелковой нити при кокономатании. По требованию, шелковая нить должна быть гладкой, непрерывной по длине и равномерной по толщине. Сложением вместе некоторого числа контроля шелковой нити, в процессе ее выработки, получаем информацию, точно отражающую значение толщины нити. С этой целью, для процесса контроля было предложено применение тензосенсоров и микропроцессоров.